

真空脱ガス炉 SBF-1100



真空脱ガス炉SBF-1100はガラスフリット等を、大気圧雰囲気、不活性ガス雰囲気、真空雰囲気下で熱処理を行う装置です。ガス圧力を自動で制御し、圧力を一定にしたまま作業が可能です。

真空脱ガス炉SBF-1100仕様

- 到達圧力 4.0×10⁻¹Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 最高温度 1,100℃(大気圧の場合は600℃)
- 昇温時間 600℃迄3時間以内
1,100℃迄4時間以内
- 炉内寸法 φ498mm×L525mm SUS304
- 有効棚寸法 248mmW×250mmD×203mmH
- 棚数 1段
- 加熱機構 カンタルAF製ヒーター
- 加熱制御 サイリスタ制御
PID方式温調計(プログラム温調計含む)
- 真空排気系 油回転ポンプ:200L/min[50Hz]
メカニカルブースターポンプ:833L/min[50Hz]
- 真空計 ピラニ真空計/バラトロン真空計
- 自動圧力制御機構(APC機構)
- 操作方法 手動/自動操作可能
- 制御系 シーケンサー/タッチパネル/デジタル記録計
- ユーティリティ 電気:AC200V三相15kVA
冷却水:12L/min以上0.15MPa以上0.2MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
設置寸法:1,300mmW×1,100mmD×1,676mmH

